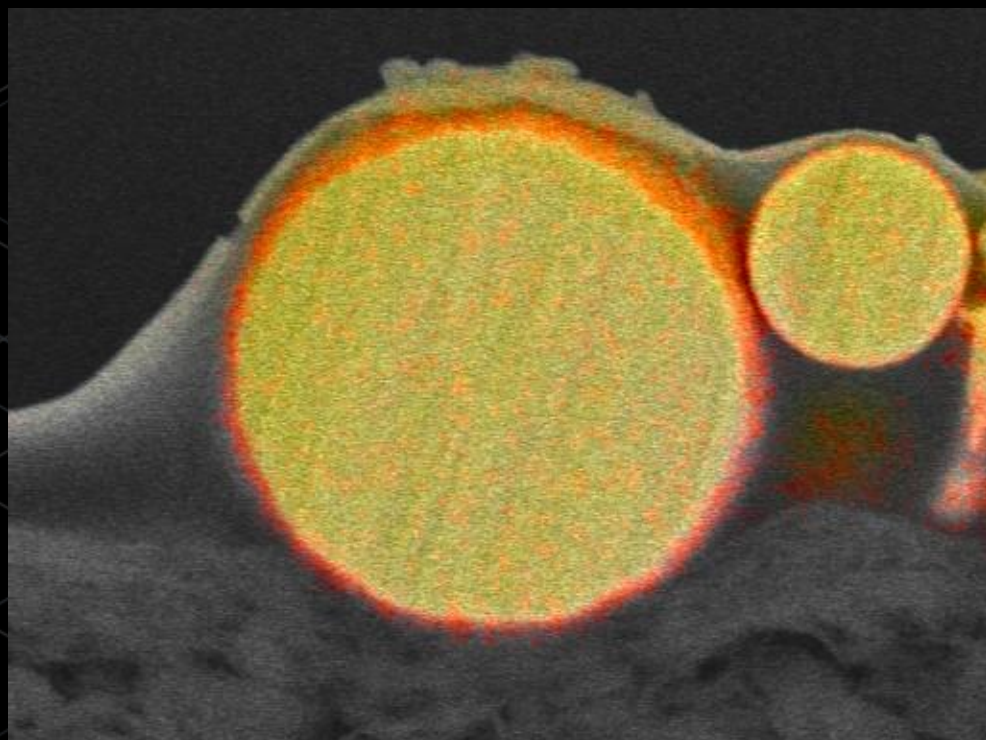


粉体スパッタ装置 OCTURE

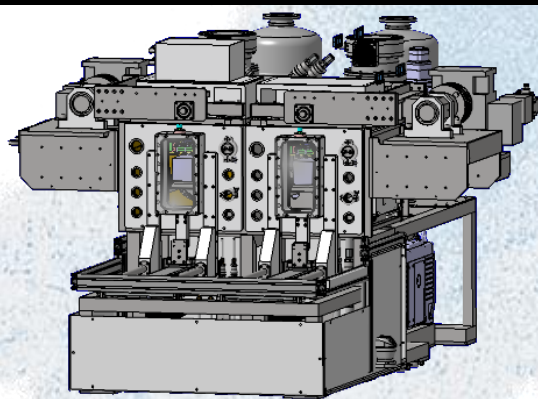


5μm

粉末の全周に
コーティングが可能

特徴

- ・ 全面成膜を可能にする独自の振動機構
- ・ 2室構造で絶縁膜・金属膜の成膜に対応
- ・ 高効率/均一な成膜品質



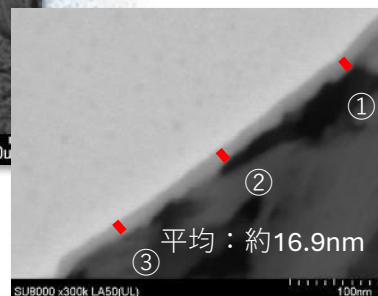
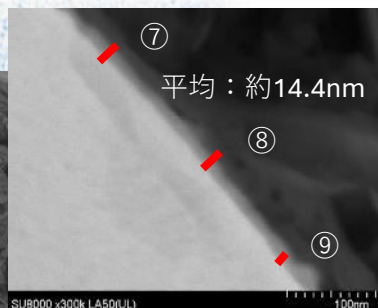
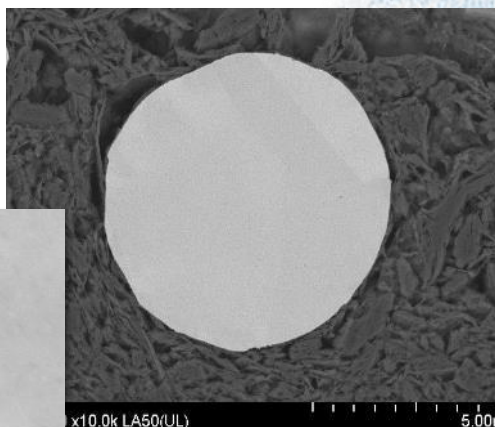
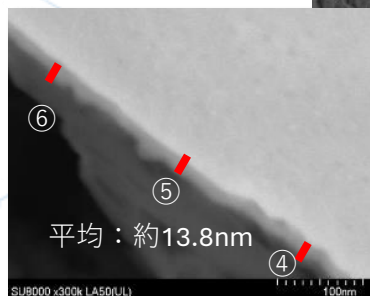
用途・応用例

分野	項目	用途
エネルギー 電子材料	全固体電池	正極材及び負極材
	磁性材料	圧粉コア及び電子部品の磁性材パッケージ
自動車 化学 その他	金属材料	粉末冶金
	その他	触媒、導電性ペースト、3Dプリント 等

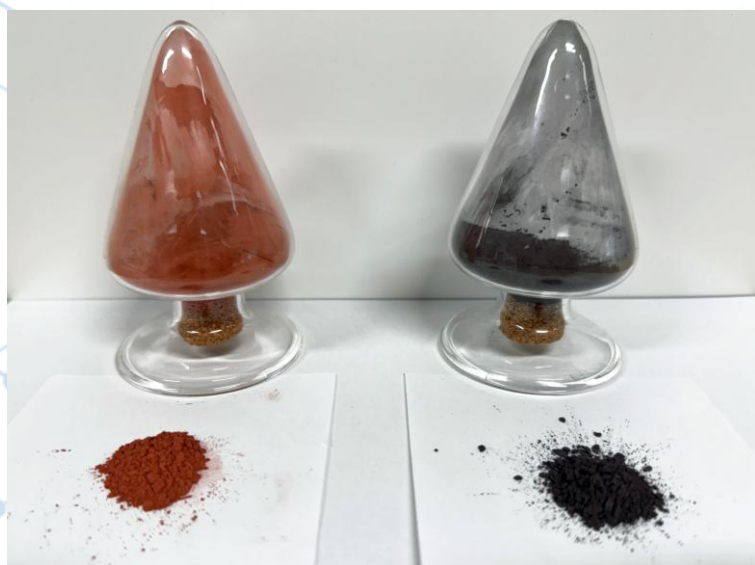
粉体スパッタ例 Cu粉へのTi成膜

①断面SEM

粒径：3～5 μ m
膜厚：約15nm



②成膜前・成膜後比較



ご質問・詳細につきましては、
営業部までお気軽にお問合せください。

お問合せ先【営業部】

本社・相模原工場
〒252-0244
神奈川県相模原市中央区田名3062-10

TEL. 042-764-0370

E-mail. sales-pamphlet@showashinku.co.jp
<https://www.showashinku.co.jp/>

昭和真空

検索

本資料に記載の製品仕様・外観は、改良のため
予告なく変更する場合があります。

本資料に記載の製品は外国為替並びに外国貿易
管理法の規定により、戦略物資等輸出規制品
に該当する場合があります。
従って、日本国外に該当品を持ち出す際は、日本
国政府への輸出許可申請等、必要な手続きをお
取ください。

金属膜だけでなく、絶縁膜も成膜可！
新しい成膜方法をお考えの方は
ぜひ当社へご相談ください！

Web site 製品情報ページ

真空中で特定の基板に薄膜を形成させる
装置を主とした、真空蒸着装置やス
パッタリング装置等の真空技術応用装
置(真空装置)を製造販売しております。

<https://www.showashinku.co.jp/product/>

